# 软 X 射线辐照引起的铟锡氧化物 表面光化学反应

#### 刘黎明 熊玉卿 郭 云 李冠斌 杨得全

(中国空间技术研究院兰州物理研究所应用表面物理实验室,兰州 730000) (1999年10月16日收到,2000年4月8日收到修改稿)

利用 XPS 原位研究了 Mg Ka X 射线辐照对 ITO 表面的影响. 结果表明 随着 X 射线辐射时间的延长 表面辐照区域 In Sn 相对含量增加 ,而 O 则逐渐减少 ,同时 ,In ,Sn3d 光电子峰随 X 射线辐射的增强而变化. 分析说明 X 射线的辐照导致了 ITO 表面光化学反应 ,氧的脱离使 In Sn 有被还原的趋势 ,受损较重的 In 明显存在亚氧化态. In Sn 俄歇参数的变化进一步证实 ITO 表面发生了光化学反应. 并讨论了 X 射线引起 ITO 表面光化学反应的机制.

关键词:X射线辐照,光电子能谱,光化学反应 PACC:8250G,7960,8250

### 1 引 言

铟锡氧化物即 ITO 是一种简并的 n 型半导体 材料,由于对可见光有很高的透过率同时具有很高 的电导率 因而被广泛地用于光电器件 这种用途使 ITO 不可避免地暴露在各种辐射环境中,所以 ITO 膜的抗辐射能力成为一个关注的问题,基于 ITO 制 备的光电器件在辐射环境中的性能变化,研究 ITO 在辐射条件下的电离辐射损伤 对光电器件抗辐射 加固有重要意义,有实验表明经原子氢的辐射,ITO 膜的化学成分会发生变化,其光电性能变差11. Morgan 等人证实了 ITO 膜对中子有极高的抗辐射 阻力<sup>[2]</sup>. Bowman 等人的研究则表明紫外辐射、热周 期变化、电子辐射及电子和中子的同时辐射对 ITO 膜的损伤都很小 JTO 是空间用射频透光天线的一 种理想的保护材料<sup>3]</sup>目前,低能 X 射线对 ITO 表 面的电离损伤尚未见报道,但作者在对 ITO 膜的 X 射线光电子能谱仪(XPS)测试中发现较长时间的采 谱会引起表面变色,本工作利用 XPS 对 ITO 样品进 行原位低能 X 射线辐照和 XPS 分析 并对软 X 射 线辐照引发的光化学机制进行了试探性解释.

#### 2 实 验

本实验分析的 ITO 膜样品由莱宝公司提供 ,膜

基底为石英玻璃.实验中对样品进行原位软 X 射线 辐照(使用  $M_gK_\alpha$  X 射线),接着进行原位 XPS 采 谱,即在实验过程中所有的参数设置均保持不变.整 个实验过程是在英国 VG 公司生产的 ESCALAB-220IXL 表面分析系统中完成的.实验中本底真空度 优于  $1.0 \times 10^{-8}$  Pa  $M_gK_\alpha$ X 射线采用 300 W 痛照 面积为 1 mm<sup>2</sup>,入射 X 射线束与样品表面夹角为 50°,能量分析器与样品表面垂直,通道能量设为 30 eV 透镜模式用大面积(带磁透镜).样品先进行原 始表面谱收集,接着经 X 射线辐照时间总计 15 A0, 60 90 min,然后各进行一次采谱.实验数据用 VG 提供的 Eclipse V2.0 Rev02 专用软件进行处理.

### 3 结果与讨论

由于受 X 射线激发后只有非常表面的光电子 才能逃逸出来(采样深度 5.0 nm 左右),所以一般认 为 XPS 是非破坏性的表面分析技术<sup>41</sup>. 但是,有研 究发现,X 射线对聚合物材料有辐射损伤<sup>5,61</sup>. 近来 有报道软 X 射线辐照会引起光电池材料 InP 表面 电子态变化<sup>[71]</sup>,而电极材料 Pd 在 XPS 分析时间内 受到明显的 X 射线辐照损伤<sup>81</sup>. 本实验分析的 ITO 样品表面有少量 C 污染,但为了不至于引入 Ar 离 子束损伤,故未作 Ar 离子溅射清洁处理. 表 1 列出 了 ITO 表面 O, In ,Sn 三种成分的相对原子百分含 量随 X 射线辐照时间的变化. 明显可见,随着辐照时间增加, In ,Sn 含量增加而同时 () 含量递减, 即随着 X 射线辐照的增强, 表面逐渐缺氧而 In ,Sn 则逐渐富集在表面. In ,Sn ,O 化学计量比的变化可能暗示 X 射线引起表面光化学反应.

<b>長</b> 1 ビ	FO 表面氧、	锡、铟	三种成分随	Х	射线辐照时间的变化
--------------	---------	-----	-------	---	-----------

相对含量/% 辐照时间 /min.	<b>氧(</b> ())	锡( Sn )	铟(In)
0	59.057	5.128	35.814
15	57.593	5.800	36.877
40	56.983	5.830	37.216
60	56.424	5.929	37.646
90	56.311	5.969	37.721

为了证实辐射区域 In ,Sn 化学状态的改变,图 1 2 分别给出了 Sn3d ,In3d<sub>5/2</sub>光电子峰随 X 射线辐 照时间的变化情况.图 1 中 A ,B ,C 峰依次代表原 始表面、X 射线辐照 15 min ,X 射线辐照 90 min 收 集的 Sn3d 光电子峰.比较可见,A ,B 两峰形状相 同,但 B 峰有更高的背底,主要是因为经 X 射线辐 射后二次电子产额变大,增强了背底.A ,B 两峰结 合能为 486.7 eV,对应 SnO<sub>2</sub> 状态的 Sn3d<sub>5/2</sub><sup>[9]</sup>.而 C 峰结合能位于 486.5 eV,相对 A、B 两峰有 0.2 eV 的负化学位移.参照金属态 Sn3d<sub>5/2</sub>结合能 485.0  $eV^{[10]}$ ,可认为经 X 射线辐射 SnO<sub>2</sub> 有向 Sn 转化的 趋势.

图 2 中 D , E , F 峰依次代表原始表面、X 射线 辐照 15 min、X 射线辐照 90 min 收集的 In3d 光电子 峰 与 Sn3d 变化情况相似 , D , E 两峰峰形基本一



图 1 Sn3d 光电子峰随辐照时间的变化 (A 峰为原始表面收集的谱 ;B 为辐照 15 min 后收集的谱 ;C 峰为辐照 90 min 后收集的谱 )

致 峰位均在 444.6 eV ,说明此时 In 处于  $In_2O_3$  的 化学状态<sup>11]</sup>. 但 F 峰则明显不是一个高斯-洛伦兹 峰 ,而是多个峰的叠加结果.



图 2 In3d<sub>5/2</sub>光电子峰随辐照时间的变化 ( *D* 峰为原始表面收 集的谱 ;*E* 为辐照 15 min 后收集的谱 ;*F* 峰为辐照 90 min 后收 集的谱 )

对 F 峰(In3d<sub>5/2</sub>)进行优化迭代拟合,拟合过程 中峰 位 置、高度 和 面 积 均 允 许变 动,半 高峰 宽 (FWHM)限制在 1.8—2.0 eV,每个拟合的峰代表 高斯和洛伦兹函数的线性组合,并假定在本分析系 统的实验条件下,高斯成分和洛伦兹成分之比为 0.3 时最佳.拟合结果如图 3 所示,得到  $P_1$ , $P_2$ , $P_3$ 三个高斯-洛伦兹峰,其结合能位置依次为 445.30 eV,444.30 eV,444.0 eV.根据 Wagner 的研究结 果<sup>10</sup>], $P_1$ 对应 InO<sub>x</sub> 态, $P_2$ 对应 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 态, $P_3$ 对应 In 态.可见,经 90 min 的 X 射线辐照,ITO 表面逐 渐分离出亚氧化态的 In,甚至产生金属态 In.相对 而言,X 射线辐照对 In 原子的影响大于 Sn 原子.



图 3 辐照 90 min 后采集的 In3d<sub>5/2</sub>光电子峰最优化拟合结果 (P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>,P<sub>3</sub>结合能位置依次为 445.30 eV,444.30 eV,444.0 eV)

α <sup>*</sup> 辐照时间 /min.	铟(In)	锡( Sn )	参考的	俄歇参数	参考文献
0	851.70	919.42	In	854.5	[11]
15	851.82	919.56	$\mathrm{In_2O_3}$	851.6	[12]
40	852.13	919.63	$InO_x$	851.7	[13]
60	852.30	919.91	Sn	922.4	[14]
90	852.86	920.80	$\mathrm{SnO}_2$	919.4	[12]
			$SnO_x$	919.2	[14]

表 2 铟、锡俄歇参数随 X 射线辐照时间的变化 及相关参考的俄歇参数

为进一步确证以上光化学的发生,考查了 In, Sn 俄歇参数  $a^*$ 随 X 射线辐照时间的变动情况( 见 表 2 ). 俄歇参数不受荷电效应的影响,故有很好的 指纹鉴定作用.表中  $a^* = E_{KA} + E_{BP}$ , $E_{KA}$ 代表 X 射 线激发的 M<sub>4</sub>N<sub>45</sub>N<sub>45</sub>俄歇发射电子的动能, $E_{BP}$ 代表 3d<sub>5/2</sub>光电子结合能.可以看到,X 射线辐照前,In Sn 的俄歇参数  $a^*$ 与参考文献给出的相关 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 态、 SnO<sub>2</sub> 态的俄歇参数相同,而随着辐照增强, $a^*$ 值逐 渐增大并靠近相关金属态的俄歇参数值.这进一步 证明了 In Sn 在 X 射线的辐照作用下有被还原的 趋势.但 X 射线辐照 90 min 后,In ,Sn 的俄歇参数  $a^*$ 与其金属态的俄歇参数值还有近 2.0 eV 的差 值,这说明它们被还原的程度还是很低的.

X 射线辐照引起表面光化学的机制一般认为是 被原子吸收的 X 射线能量不仅可以通过激发光子 衰减,还可以通过激发电子、中子、离子的方式衰 减<sup>151</sup>.继基本的激发和俄歇衰减之后,可能有离子 的释放过程发生,离子的势能可以转化为离子释放 所需要的动能,而那些有足够能量克服表面势阻的 离子可能挣脱表面其他原子的束缚逃逸到真空<sup>161</sup>. 可见,这类化学反应的过程是吸收了 X 射线能量的 原子在能量衰减的过程中被活化,活化的原子具有 流动性,由于其扩散和迁移,原子间的化学键受损, 甚至被永久性破坏.较长时间的 X 射线辐照 ITO, 导致部分 In—O Sn—O 键被打断,有些 In Sn 原子 迁移到表面,而氧可能迁移到别的未辐照区域,或扩 散到衬底,甚至可能逃逸到真空.

#### 4 结 论

ITO 表面的原位 MgKα X 射线辐照和原位 XPS 分析说明 X 射线引致了 ITO 表面光化学反应. 由此可见 在 XPS 测试中(特别是在重复测试长时 间采谱如深度剖析实验中)应该谨慎处理那些对 X 射线敏感的材料 ,因为长时间的 X 射线辐照可能导 致一些信息的改变.

- [1] Je-Hsiung Lan, J. Kanicki, Thin Solid Films, 304 (1997), 123.
- [2] D. V. Morgan, A. Salehi, Y. H. Aliyu, R. W. Bunce, D. Diskett, *Thin Solid Films*, 258 (1995), 283.
- [3] C. Bowman, A. Bogorad, G. Brucker, S. Seehra, T. Lloyd, IEE Transaction on Nuclear Science 37 (1990), 2134.
- [4] D. T. Clark, Adv. Polym. Sci., 24 (1977), 125.
- [5] S. Akhter , K. Allan , D. Buchanan , J. A. Cook , A. Campion , J. M. White , *Appl. Surf. Sci.* , **35** (1988/89), 241 ; J. W. Rogers , J. A. Kelber , M. A. Henderson , J. M. White , *Appl. Surf. Sci.* , **35** (1988/89) , 423.
- [6] A. H. K. Fowler, H. S. Munro, D. T. Clark, Polym. Degrad. Stab., 11 (1985), 287.
- [7] N. M. D. Brown, J. A. Hewitt, B. J. Meenan, Surface and Interface Analysis, 18 (1992), 187.
- [8] Zhi-an Yang et al., Acta Physica Sinica, 48(1999), 1113(in Chinese)[杨志安、靳涛、杨祖慎、奎热西、崔明启、刘凤琴,物 理学报 48(1999), 1113].
- [9] A.W.C. Lin, Anal. Chem., 49(1977), 1228.
- [10] C. D. Wagner, Handbook of X-ray and Ultra-Violet Photoelectron Spectroscopy ( D. Briggs, Heyden & Sons, London, 1977), Chapter 7.
- [11] D.T.Clark, Thin Solid Films, 70 (1980), 261.
- [12] A. W. C. Lin, N. R. Armstrong, T. Kuwana, Anal. Chem., 49 (1977), 1228.
- [13] C.D. Wagner, J. Chem. Soc. Far. Disc., 60 (1975), 306.
- [14] C.D. Wagner, Farady Discuss Chem. Soc., 60(1975), 291.
  - [15] A.P.Hitchcock, Phys. Scr., 31 (1990), 159.
  - [16] P. J. Feibelman, M. L. Knotek, *Phys. Rev.*, 18 (1978), 6531; M. L. Knotek, P. J. Feibelman, *Surf. Sci.*, 90 (1979), 78.

## PHOTOCHEMICAL REACTION ON ITO SURFACE INDUCED BY SOFT X-RAY IRRADIATION

#### LIU LI-MING XIONG YU-QING GUO YUN LI GUAN-BIN YANG DE-QUAN

( Lab of Applied Surface Physics , Lanzhou Institute of Physics , Chinese Academy of Space Technology , Lanzhou 730000 , China )
( Received 16 October 1999 ; revised manuscript received 8 April 2000 )

#### Abstract

ITO surface photochemical reaction induced by soft X-ray (Mg Ka = 1253.60 eV) irradiation is investigated in-situ by XPS technique. The result shows that the content of In and Sn in the irradiated area goes up with the increasing irradiation time, while that of O falls. The changes of In3d, Sn3d XPS spectra and the Auger Parameter of In, Sn suggest that there is chemical reaction due to X-ray irradiation. It can be concluded that more photo-dissociation happens to In element according to the obvious fact that there exists sub-oxidized state of In after exposure to X-ray. The photochemical reaction mechanism induced by soft X-ray irradiation is discussed.

Keywords : irradiation by X-ray , photoelectron spectroscopy , photochemical reaction PACC : 8250G , 7960 , 8250